



## 参数

仪器名称：磁控溅射仪	型号：SD-981M	
<p>原理：</p> <p>在磁控溅射中，由于运动电子在磁场中受到洛仑兹力，它们的运动轨迹会发生弯曲甚至产生螺旋运动，其运动路径变长，因而增加了与工作气体分子碰撞的次数，使等离子体密度增大，从而磁控溅射速率得到很大的提高，而且可以在较低的溅射电压和气压下工作，降低薄膜污染的倾向；另一方面也提高了入射到衬底表面的原子的能量，因而可以在很大程度上改善薄膜的质量。同时，经过多次碰撞而丧失能量的电子到达阳极时，已变成低能电子，从而不会使基片过热。</p>		
<p>参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 主机规格：长 510mm×宽 310mm×高 290mm（含腔体）</li> <li>✧ 靶材：Au（标配）50mm×0.1mm（D×H）</li> <li>✧ 样品室：玻璃腔体直径 180mm×高 120mm（D×H）</li> <li>✧ 样品台直径：Φ70mm</li> <li>✧ 靶材尺寸：Φ50mm</li> <li>✧ 最高真空度：1Pa</li> <li>✧ 工作真空：2-15Pa</li> <li>✧ 定时器：数码计时 0-600S</li> <li>✧ 镀膜面积：50mm</li> <li>✧ 溅射电流：0-50Ma</li> <li>✧ 真空测量：皮拉尼真空计</li> <li>✧ 触摸屏：7 寸</li> <li>✧ 程序：VPI 人机界面</li> <li>✧ 可通入气体：多种</li> <li>✧ 最高电压：500 DCV</li> <li>✧ 机械泵：VRD-8</li> <li>✧ 速率：0--60nm/min</li> <li>✧ 主机功率：100W</li> <li>✧ 工作电压：220V, 50HZ</li> </ul>		
<p>用途：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、适用于电镜实验室的扫描电子显微镜（SEM）观察前对样品的喷金、喷铂。</li> <li>2、非导体材料实验电极制作（喷金、喷铂。喷银等）</li> <li>3、其他可以满足条件的镀膜实验。</li> </ol>		
<p>特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、经济、可靠、外观精美。</li> <li>2、成膜速率高。</li> </ol>		



- 3、基片温度低，可以对温度敏感的材料进行镀膜。
- 4、可实现大面积镀膜。
- 5、可调节溅射电流和真空室压强以控制镀膜的速率和颗粒的大小，颗粒大小约 4-20nm。
- 6、VPI 触摸屏人机界面，操作简单。
- 7、真空保护可避免真空过低造成设备短路。
- 8、同时可以通过更换不同的靶材（金、铂、铱、银、铜等），以达到更细颗粒的涂层。
- 9、通过通入不同的惰性气体以达到更纯净的涂层。

## 外观



## 服务

- 1、合同的付款方式：发货前甲方按合同全款 100% 预付。
- 2、供货周期：自之合同款到帐日起 15 个工作日之内发货。
- 3、乙方保证合法经营、依法纳税、保证在收到货款后 20 天内向甲方提供 13% 增值税发票。
- 4、交货方式：乙方负责托运至甲方所在地；运费乙方负担。
- 5、产品保修：产品保修贰年；在此期间，正常使用情况下，发生故障，乙方确认不能通过电话或网络等远程方式指导修复的，由甲方托运至乙方所在地维修，运费由乙方负担。
- 6、用户方如需乙方提供上门安装培训，所需差旅费由用户方承担。